

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4904390号
(P4904390)

(45) 発行日 平成24年3月28日 (2012.3.28)

(24) 登録日 平成24年1月13日 (2012.1.13)

(51) Int.Cl.	F I
A 4 7 J 27/00 (2006.01)	A 4 7 J 27/00 I O I D
A 4 7 J 36/06 (2006.01)	A 4 7 J 36/06 E
	A 4 7 J 36/06 C

請求項の数 18 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2009-500890 (P2009-500890)	(73) 特許権者	591125670
(86) (22) 出願日	平成19年3月23日 (2007.3.23)		セブ ソシエテ アノニム
(65) 公表番号	特表2009-530003 (P2009-530003A)		フランス国, 69130 エキュリ, レ
(43) 公表日	平成21年8月27日 (2009.8.27)		4エム, シュマン デュ プチ ポワ (
(86) 国際出願番号	PCT/FR2007/000505		番地なし)
(87) 国際公開番号	W02007/107656	(74) 代理人	110000338
(87) 国際公開日	平成19年9月27日 (2007.9.27)		特許業務法人原謙三国際特許事務所
審査請求日	平成20年12月11日 (2008.12.11)	(72) 発明者	ベルジュレ, ナタリー
(31) 優先権主張番号	0602537		フランス, エフ-73100 エクス-レ
(32) 優先日	平成18年3月23日 (2006.3.23)		-バン, リュ ヴァンソン ダンディ, 4
(33) 優先権主張国	フランス (FR)	(72) 発明者	1
			ロルティワール, クリストフ
			フランス, エフ-74150 プロユ, レ
			グレッベ

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シリコンガasketを備えた調理器具用カバー

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

調理器具(2)を覆うように設計されたフタ(3)と、上記フタ(3)の周りを囲むシリコンガasket(4)とを備えている調理器具(2)用カバー(1)であって、

上記ガasket(4)は、上記フタ(3)の周囲(6)よりも半径方向に向かって少なくとも10mm延伸しており、

上記ガasket(4)内に少なくとも1つの通路(12、13、14、15、16、21、50)が設置されていることを特徴とする調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項 2】

上記ガasket(4)は、上記フタ(3)の周囲(6)よりも半径方向に向かって15mm延伸していることを特徴とする請求項1に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項 3】

上記ガasket(4)は、上記フタ(3)の周囲にオーバーモールドされていることを特徴とする請求項1または2に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項 4】

上記ガasket(4)は、上記調理器具(2)上に上記カバー(1)を中央揃えして配置するためのセンタリング手段(8、9、10、11)を備えていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項 5】

上記センタリング手段(8、9、10、11)は、上記フタ(3)における上記周囲(

6)の外側に半径方向に向かって延伸することを特徴とする請求項4に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項6】

上記ガasket(4)が、上記カバー(1)の両側上にセンタリング手段(10、11)を備えることを特徴とする請求項4または5に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項7】

上記センタリング手段(10、11)が、上記ガasket(4)の周縁によって構成されていることを特徴とする請求項4から6のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項8】

上記センタリング手段(8、9)が、上記ガasket(4)によって保持される下降壁(8、9)によって構成されていることを特徴とする請求項4から6のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項9】

上記カバー(1)は、上記調理器具(2)上に配置され、
上記少なくとも1つの通路(12、13、14、15、16、50)は、上記調理器具(2)から上記通路(12、13、14、15、16、50)を介して蒸気を排出できるように設けられていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項10】

上記少なくとも1つの通路(50)が、上記フタ(3)の上記周囲(6)まで半径方向に延伸する上記ガasket(4)における覆い部分(5)内に設置されており、
上記通路(50)は、上記フタ(3)を作られた開口部(51)の延長部分であり、蒸気が排出できるように上記フタ(3)の側面上に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項11】

上記ガasket(4)が、蒸気排出のための上記開口部を形成するように、上記フタ(3)内に設置された上記開口部(51)を通ることによって上記フタ(3)の側面に設けられた2つの蒸気孔(52、53)に結合する固形管状壁(54)を備えることを特徴とする請求項10に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項12】

上記少なくとも1つの通路(12、13、14、15、16、21)が、上記フタ(3)における上記周囲(6)の外側に半径方向に延伸する上記ガasket(4)における延伸部(7)内に設置されていることを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項13】

上記ガasket(4)は、上記調理器具(2)上に上記カバー(1)を中央揃えして配置するためのセンタリング手段(8、9、10、11)を備えており、
上記少なくとも1つの通路(12、13)が、蒸気を排出できるように上記センタリング手段(8、9、10、11)より半径方向内側に入り込んでいる上記延伸部(7)内に設置された隙間によって構成されていることを特徴とする請求項12に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項14】

上記ガasket(4)は、上記調理器具(2)上に上記カバー(1)を中央揃えして配置するためのセンタリング手段(8、9、10、11)を備えており、
上記少なくとも1つの通路(14)が、蒸気が排出できるように上記センタリング手段(8、9、10、11)より半径方向内側に、上記延伸部(7)内に設置された蒸気孔によって構成されていることを特徴とする請求項12または13に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項15】

10

20

30

40

50

上記ガスケット(4)は、上記調理器具(2)上に上記カバー(1)を中央揃えして配置するためのセンタリング手段(8)を備えており、かつ、

上記センタリング手段(8)は、上記ガスケット(4)によって保持される下降壁(9)によって構成されており、

上記少なくとも1つの通路(16)が、上記下降壁(9)内に設置された蒸気孔によって構成されていることを特徴とする請求項8、12、14のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項16】

上記ガスケット(4)が、蒸気を排出させることができる通路と連結され、かつ、上記通路を露出させる開口位置と上記通路を遮蔽する閉口位置との間を変位することができる可撓性フラップを備えることを特徴とする請求項1から15のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

10

【請求項17】

上記カバー(1)が、上記ガスケット(4)によって保持される把持部材(20、21)を備えることを特徴とする請求項1から16のいずれか1項に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【請求項18】

上記把持部材(20、21)は、上記ガスケット(4)の厚さを備えていることを特徴とする請求項17に記載の調理器具(2)用カバー(1)。

【発明の詳細な説明】

20

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、例えばフライパンカバーなどの、調理器具用カバーに関する。

【0002】

英国特許明細書2302263によると、調理器具を覆うように設計されたフタと、当該フタの周りを取り囲むシリコンガスケットとを備えた様式の調理器具用カバーが知られている。この文献においてガスケットは、実質的にフタの周囲に沿って覆うだけの、相対的に一定の幅のシールである。

【0003】

本発明の目的は、カバーおよびガスケットに取り込むための、新たな機能性を有するガスケットを備えたカバーを提供することにある。

30

【0004】

本発明によると、ガスケットは、フタの周囲よりも少なくとも10mm、さらには16mm長く、半径方向に向かって延伸する。ガスケット自体の表面が大きいいため、カバーのフタを交換することなく、通路用に、蒸気またはいずれかの設備のための開口部をその中に備えることが可能である。

【0005】

さらなる特徴および利点は、これに限定されるものではないが、図面に示す6つの主な実施形態によって、より明確に説明できる。

【0006】

40

図1は、本発明の第1の実施形態に係るカバー(把持部材なし)の底部を示す斜視図である。

【0007】

図2は、図1に示すカバーの半径の末端を示す断面図である。

【0008】

図3は、本発明の第2の実施形態に係るカバーの概略的な斜視図であり、カバーが調理器具の上に設置されていることを示す。

【0009】

図4は、本発明の第3の実施形態に係るカバーの半径の末端を示す概略的な断面図であり、カバーが調理器具の上に設置されていることを示す。

50

【 0 0 1 0 】

図 5 は、本発明の第 4 の実施形態に係るカバーを示す図 4 と同様の図である。

【 0 0 1 1 】

図 6 は、本発明の第 5 の実施形態に係るカバーを備えた調理器具の断面図である。

【 0 0 1 2 】

図 7 は、本発明の第 6 の実施形態に係るカバーの概略的な斜視図であり、カバーが調理器具上に設置されていることを示す。

【 0 0 1 3 】

図 8 は、本発明の第 7 の実施形態に係るカバーを示す図 5 と同様の図である。

【 0 0 1 4 】

図 9 は、本発明の第 8 の実施形態に係るカバーを示す斜視図である。

【 0 0 1 5 】

図 1 ~ 9 からわかるように、調理器具 2 用のカバー（調理器具用カバー）1 は、一方では、カバー 1 の主要部分を構成するとともに、調理器具 2 を覆うように設計されたフタ 3（例えばガラス製）を備え、もう一方では、フタ 3 の周りを取り囲むガスケット 4 を備える。本発明において、ガスケット 4 はシリコン製であり、フタ 3 のオーバーモールド成形の際に製造される。

【 0 0 1 6 】

図 2 に示すように、ガスケット 4 は半径方向に 2 つの部位、すなわち、フタ 3 の一部を覆う被覆部 5（被覆部 5 はフタ 3 の周囲 6 へ向かって半径方向に延伸する）と、フタ 3 のどの部分も覆っていない延伸部 7（延伸部 7 はフタ 3 の周囲 6 よりも外側に設置されている）を含む。

【 0 0 1 7 】

本発明によると、ガスケット 4 はフタ 3 の周囲を越えて、フタ 3 のほぼ全周（角度の観点から）に、少なくとも 10 mm、さらには 16 mm 長く半径方向に延伸しており、延伸部 7 は、半径方向に向かって少なくとも 10 mm、さらには 15 mm と等しい寸法を有している。

【 0 0 1 8 】

一方、ガスケット 4 は、カバー 1 を調理器具 2 の中心に設置できるようにするセンタリング手段 8、9、10、11 を備える。

【 0 0 1 9 】

図 1、2、5 および 8 に示す実施形態において、これらセンタリング手段 8、9 は下降壁（falling wall）8、9 によって構成されている。より正確には、図 1 および 2 の実施形態において、センタリング手段 8 はセンタリングスタッド 8（この場合 4 つ）によって構成されている。センタリングスタッド 8 は、ガスケット 4 の周囲に配置されるとともに、角断面（angular section）に延伸する。図 5 および 8 に示す実施形態において、センタリング手段 9 はガスケット 4 の周囲を延伸する環状壁 9 によって構成されている。

【 0 0 2 0 】

図 2 および 5 に示す実施形態において、下降壁 8、9 は、フタ 3 の周囲 6 より外側に半径方向に延伸する。すなわち、それらは少なくとも部分的（ここでは全体的）に延伸部 7 に保持されている。図 8 に示す実施形態において、下降壁 9 はフタ 3 の前で、半径方向に延伸する。それらは少なくとも部分的（ここでは全体的）に被覆部 5 に保持されている。

【 0 0 2 1 】

図 6 の実施形態は、下降壁によってではなくガスケット 4 の周囲によって構成されているセンタリング手段 10、11 を示す。さらに、本実施形態において、ガスケット 4 は、カバー 1 の両側にセンタリング手段 10、11 を備えており、2 つの調理器具 2、2 a が互いに対向して格納され得るようになってきている。2 つの調理器具 2、2 a の周縁は、カバーの両側におけるセンタリング手段 10、11 に対応する寸法を有する（本実施形態において、両側のセンタリング手段 10、11 は同一である）。

【 0 0 2 2 】

10

20

30

40

50

ガスケット 4 における延伸部 7 の寸法が大きいので、ガスケット 4 は (this latter) センタリング手段 8、9、10、11、および、図 1 ~ 5 に記載の実施形態のように、開口部 12、13、14、15、16 を支持することができる。

【 0 0 2 3 】

図 1 に示す実施形態において、ガスケット 4 は、一方で可動式把持部材 17 (図 6 参照) 用、またはスパチュラなどの調理器具用の通路 12 を規定し、また他方で、蒸気排出用の通路 13 を規定する。本実施形態において、両方の通路 12、13 は、ガスケット 4 の円周によって規定される開口部 12、13 である。すなわち、それらは、ガスケット 4 に作られた隙間 12、13 によってそれぞれ構成されている (これによって、ガスケット 4 の角部分における延伸部 7 の寸法を小さくする) 。

10

【 0 0 2 4 】

これら通路 12、13 を使用するため、隙間 12、13 はセンタリング手段 8 から突出する程度に、カバー 1 の内側まで半径方向に延伸する。図 3 に示す実施形態において、ガスケット 4 における延伸部 7 (より正確には、延伸部 7 の半径部分。当該部分は、調理器具 2 から蒸気が排出できるようにセンタリング手段 8 より内側にある) は、蒸気孔 14 (すなわち、その周囲が閉鎖されている開口部をいう) によって構成された蒸気排出通路 14 (この場合 5 つ) を備えている。

【 0 0 2 5 】

図 4 において、突起部 15 によって形成される蒸気排出通路 15 は、調理器具 2 の側壁上端 18 で、ガスケット 4 の延伸部 7 に局所的に作られる。図 5 において、蒸気孔 16 によって形成される蒸気排出通路 16 は、センタリング手段であるガスケット 4 によって保持される下降壁 9 内に作られる。この蒸気孔 16 は、下降壁 9 の上部であり、調理器具 2 の側壁における注ぎ口 19 の前に形成されている。下降壁、蒸気孔 16、および注ぎ口 19 の特殊な連携によって、使用可能な蒸気を排出するとともに、食品を注ぐことが可能となる。

20

【 0 0 2 6 】

図 3 および 7 には、ガスケット 4 がカバー 1 の把持部材 20、21 を保持する場合の、延伸部の半径方向における別の結果を示す。さらに、これらの実施形態において、把持部材 20、21 はガスケットの厚さに作られている。これによりカバー 1 の厚さが大幅に低減するか、または別のカバーと積み重ねるときに生じる問題を解決することが可能であり、さらにはテーブルマットの役割も果たし得る。

30

【 0 0 2 7 】

図 3 に示す実施形態において、把持部材 20 は栓 20 によって構成されており、栓 20 はガスケット 4 と一体化されているとともに (単一部材)、カバー 1 と連結する調理器具 2 よりも半径方向に大きく外側に延伸している。

【 0 0 2 8 】

図 7 に示す実施形態において、把持部材 21 (ここで、カバー 1 は 2 つの把持部材 21 を備える) は取っ手 21 によって構成されており、取っ手 21 もまたガスケット 4 と一体化されているとともに (単一部材)、カバー 1 と連結する調理器具 2 よりも半径方向に大きく外側に延伸している。

40

【 0 0 2 9 】

さらに、図 3 に示す実施形態において、ガスケット 4 は、固定用の開口部 (fastening opening) 22、すなわちカバー 1 と連結する調理器具 2 の外側に半径方向に設置された開口部 22 を保持する。また、カバー 1 を固定装置 (例えばフック) に固定することができる。

【 0 0 3 0 】

一方、図 7 に示す実施形態において、フタ 2 は連結部 23 を備える。連結部 23 は連結軸 24 を規定するとともに、ガスケット 4 の両側まで軸方向に延伸する。連結部 23 は、フタ 2 の 2 つの被覆部 25、26 をガスケット 4 によって線引きし、その結果、半分のフタ 25、26 を形成する。本実施形態において、連結軸 24 はガスケット 4 と単一の部材

50

を作っているため、各被覆部 25、26 は隣接するガスケット 4 の一部および連結軸 24 によって取り囲まれ、言わばそれ自身がガスケット 4、24 となっていてよい。

【0031】

本実施形態によると、使用の際にカバー 1 を曲げることが可能である。例えば、カバー 1 を取り外すことに関する欠点（復水が垂れること、または調理器具 2 から取り外した熱いカバー 1 が邪魔になること）に煩わされることなく、食べ物の調理状態を確認したり、かき混ぜたりすることができる。連結軸 24 のために、カバー 1 は平らな状態、または折り畳んだ状態で保管し得る。また、ガスケット 4 の厚さで作られた保持ハンドル 21（被覆部 25、26 毎に 1 つ）を備えるガスケット 4 を使用するために、折畳み状態において、それほど邪魔にならない。本実施形態において、各被覆部 25、26 はガラス製であるが、それぞれが別の材料でできていてもよい（例えば、1 つはガラス製、もう一方はステンレススチールなど）。

10

【0032】

図 8 に示す実施形態において、ガスケット 4 の被覆部 5 には、少なくとも 1 つの通路 50（この場合 1 つ）が形成されている。通路 50 はフタ 3 に作られた開口部 51 の延長部分であり、2 つの蒸気孔 52、53 から出ている。蒸気孔 52、53 は、蒸気を排出できるようにフタ 3 の側面にそれぞれ設置されている。さらに、本実施形態では、蒸気排出孔を形成するため、ガスケット 4 は管状壁 54（この場合固形）を備えている。また、管状壁 54 は、フタ 3 に作られた開口部 51 を通って蒸気孔 52 および 53 の両方とも結合している。

20

【0033】

この管状壁 54 は、開口部 51 を内包することによってフタ 3（特にガラス製である場合）の穴あけによる欠陥をカバーすることができる。さらに、シリコンガスケット 4 と一体化している（および単一部分材である）管状壁 54 は、フタがガラス製である場合は特に、シリコンガスケットのさらなる機械接続部材をフタに取り付けることも可能である。

【0034】

本発明は、図面に示された実施形態に制限されるものではない。

【0035】

一方で、ガスケットは、ガスケットにおける可撓性のあるフラップ（好ましくは単一部分材）と連結する蒸気排出孔を備えることができ、フラップは通路を露出させる開口位置と、通路を遮蔽する閉口位置との間を変位し得る。実施上の理由から、そのようなバルブは、周囲半回転分の角切片のみに穴あけすることによって作られる。

30

【0036】

シリコンガスケット内に、オーバーモールドされた保持装置を設置することができる。

【0037】

本発明に準拠するガスケットを用いることにより、カバーが 1 つも連結部を含むことなく、異なる素材（例えばガラス製とステンレススチール製）により形成された 2 つの被覆部（半分のフタ）を支持することも可能となる。

【0038】

図 9 からわかるように、シリコンガスケットに関わらず、同じ方法で管状壁 54 として用いられるシリコンリベット 62 を備えることも可能であり、蒸気を排出するためにフタ 3 に形成された開口部と連結させてもよい。このリベット 60 は、フタ 3 の穴あけによる欠陥をカバーすることができる。さらに、リベット 60 は、フタ 3 に固定するために強化された、開口部 51 を内包する管状壁と、フタ 3 のどちらかの側面に配置された 2 つの側壁 61、62 とを含む。

40

【0039】

ガスケットがフタの周囲よりも外側に少なくとも 10 mm 延伸していてもいなくても、または上述した実施形態と関連して示される 1 つの特徴を有していてもいなくても、上記シリコンリベットは、独立してか、またはいずれかの様式のガスケット（特に、シリコンガスケット）と一体化されて用いてもよい。

50

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図1】本発明の第1の実施形態に係るカバー（把持部材なし）の底部を示す斜視図である。

【図2】図1に示すカバーの半径の末端を示す断面図である。

【図3】本発明の第2の実施形態に係るカバーの概略的な斜視図であり、カバーが調理器具の上に設置されていることを示す。

【図4】本発明の第3の実施形態に係るカバーの半径の末端を示す概略的な断面図であり、カバーが調理器具の上に設置されていることを示す。

【図5】本発明の第4の実施形態に係るカバーを示す図4と同様の図である。

【図6】本発明の第5の実施形態に係るカバーを備えた調理器具の断面図である。

【図7】本発明の第6の実施形態に係るカバーの概略的な斜視図であり、カバーが調理器具上に設置されていることを示す。

【図8】本発明の第7の実施形態に係るカバーを示す図5と同様の図である。

【図9】本発明の第8の実施形態に係るカバーを示す斜視図である。

【図1】

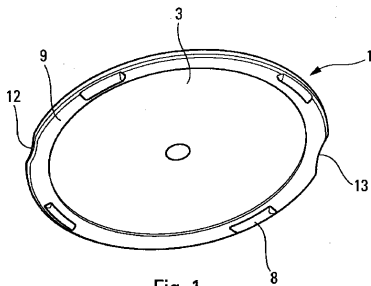


Fig. 1

【図2】

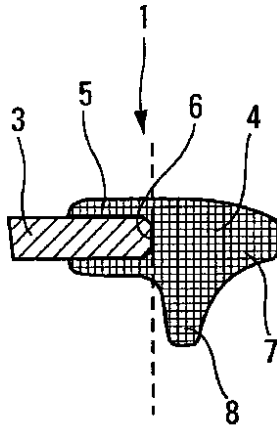


Fig. 2

【図3】

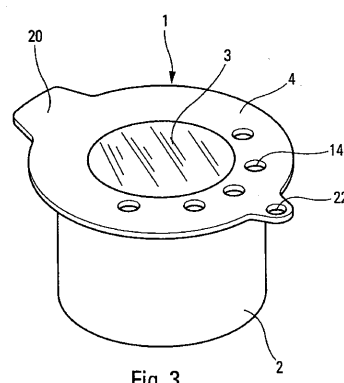


Fig. 3

【図4】

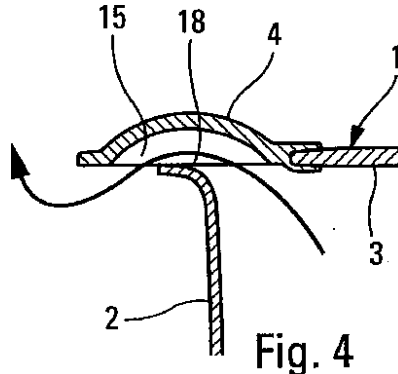


Fig. 4

【 図 5 】

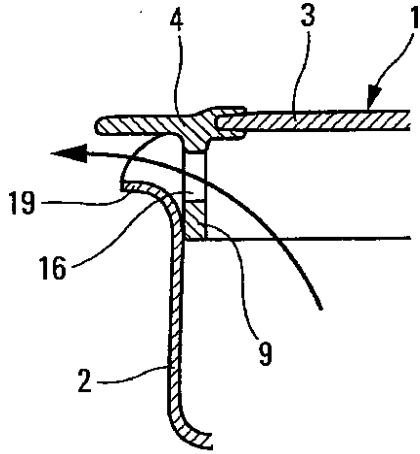


Fig. 5

【 図 6 】

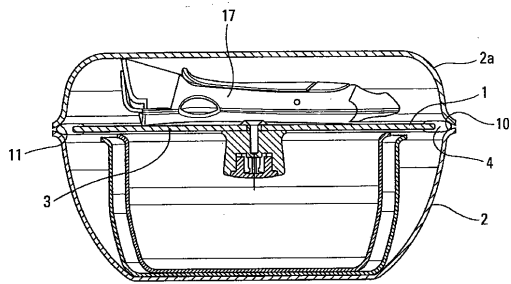


Fig. 6

【 図 9 】

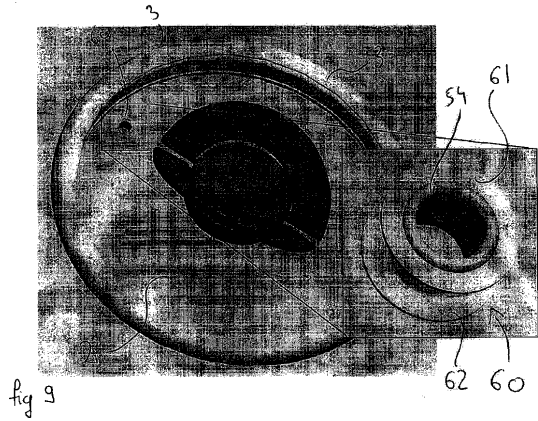


fig 9

【 図 7 】

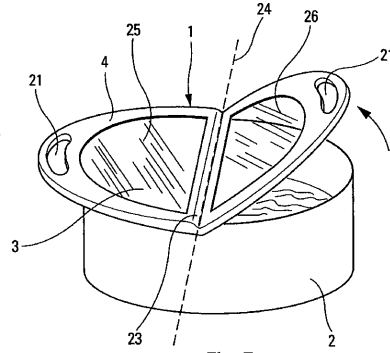


Fig. 7

【 図 8 】

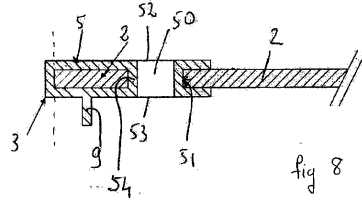


fig 8

フロントページの続き

(72)発明者 クイヨリ, パスカル
フランス, エフ - 7 4 2 1 0 ファヴェルジュ, シェマン プレ デュ ビエル, 2 0

審査官 土屋 正志

(56)参考文献 欧州特許出願公開第 0 1 1 5 7 6 4 8 (E P , A 1)
英国特許出願公開第 0 2 3 0 2 2 6 3 (G B , A)
仏国特許出願公開第 0 2 7 8 9 2 8 5 (F R , A 1)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
A47J 27/00
A47J 36/06